

ITER及びJT-60SAに向けた大電流 負イオンビームの長パルス化の進展

2016 / 3 / 14 ~ 16

若手科学者によるプラズマ研究会

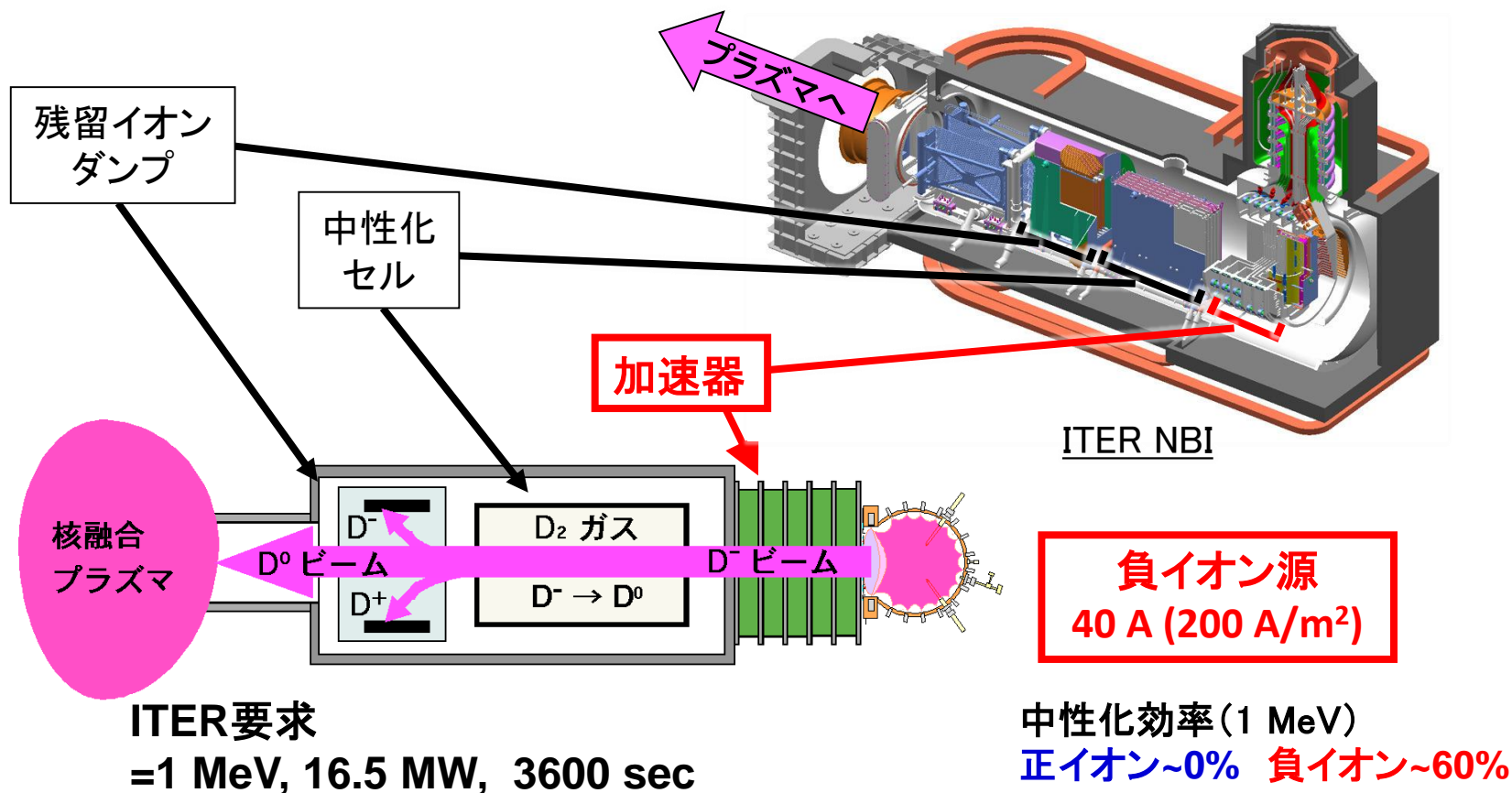
日本原子力研究開発機構

市川 雅浩、平塚 淳一、NB加熱開発グループ

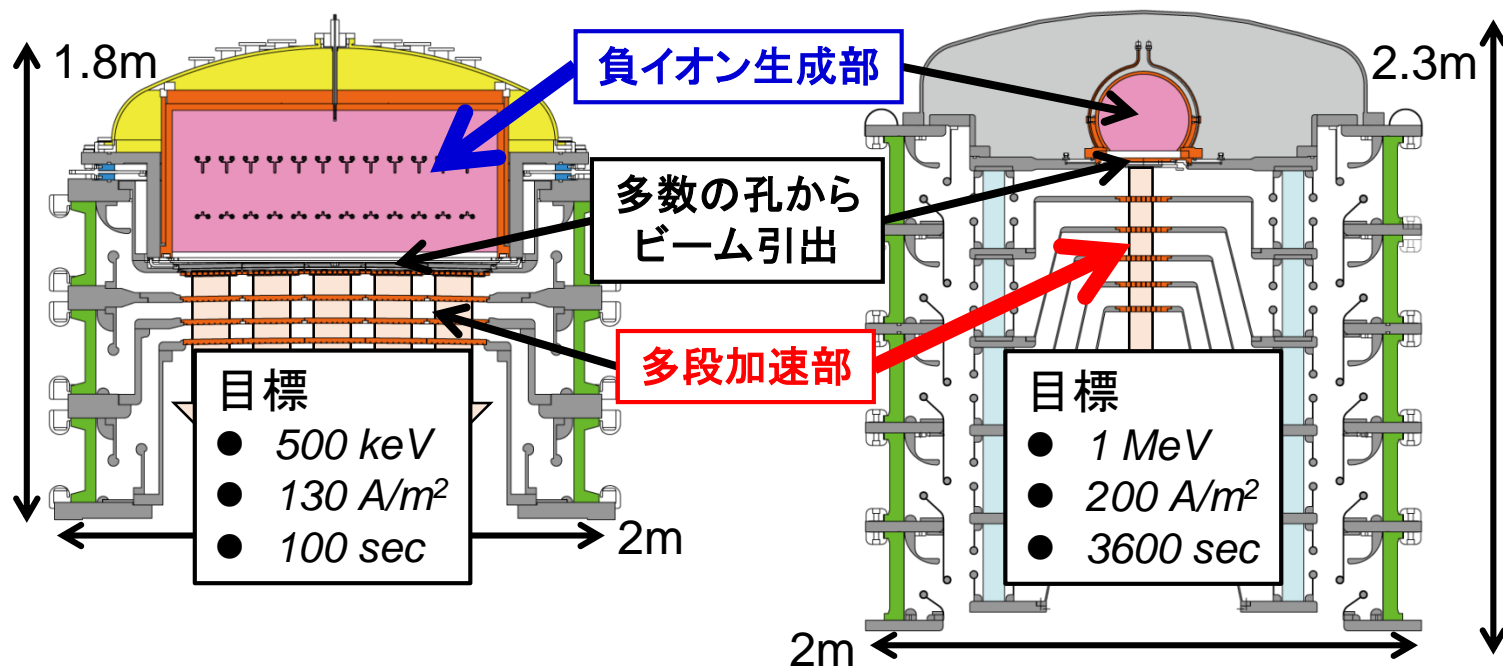
中性粒子入射装置

Neutral Beam Injection (NBI)=中性粒子入射

- 1) 中性の(重)水素ビームでプラズマを加熱する
- 2) プラズマ中に電流を流す(電流駆動)



多孔多段加速器による長パルス負イオン源の開発



<JT-60負イオン源>

- 実機JT-60SA用負イオン源
- 3段の加速器
- 1.1 × 0.45 m²大面積引出領域
- 大電流 & 長パルス 負イオン生成

<MeV級加速器>

- 日本が調達するITER用加速器を模擬
- 5段の加速器
- 高エネルギー、大電流密度

=高パワー密度 & 長パルス 負イオン加速

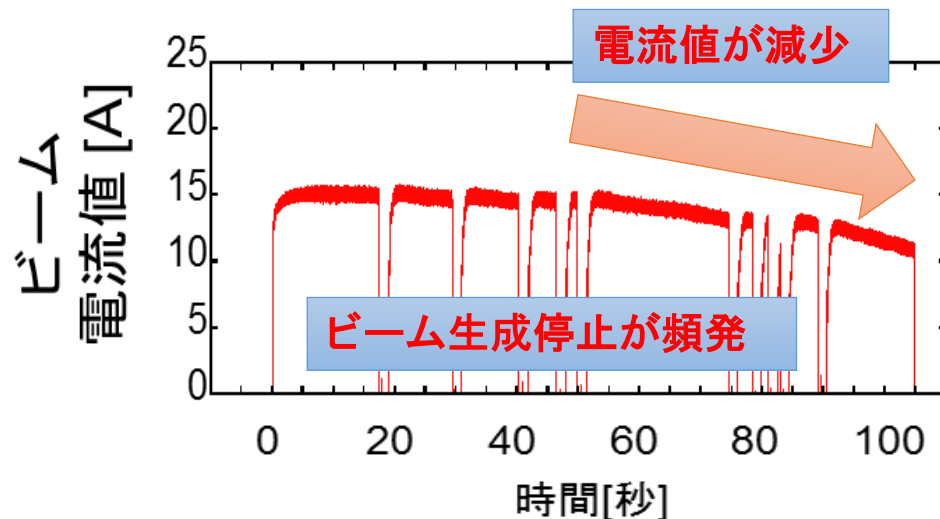
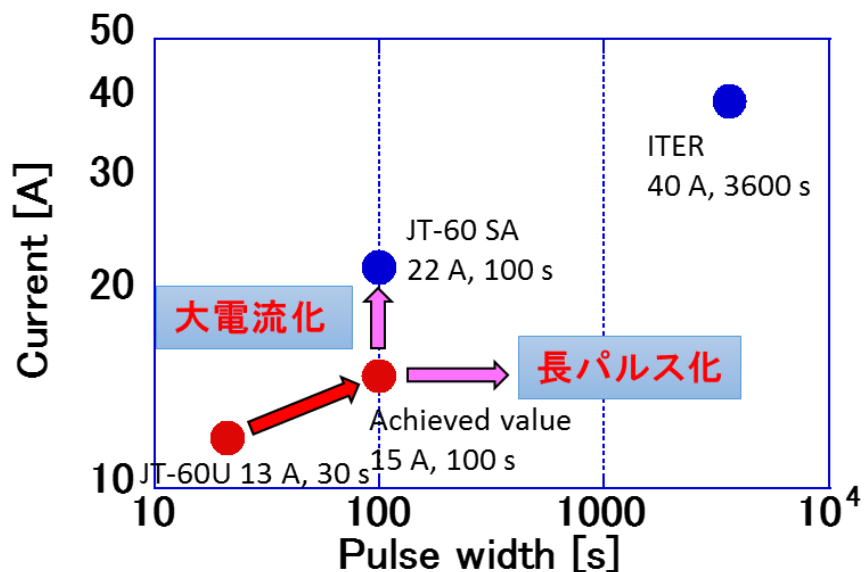
JT-60SAやITERの要求を満たす負イオン源の実現を目指し 共通課題に向けた開発を実施

JT-60負イオン源

長パルス負イオン定常生成



長パルスビーム生成における課題



これまでに15 A、100秒ビーム生成を達成
しかし・・・

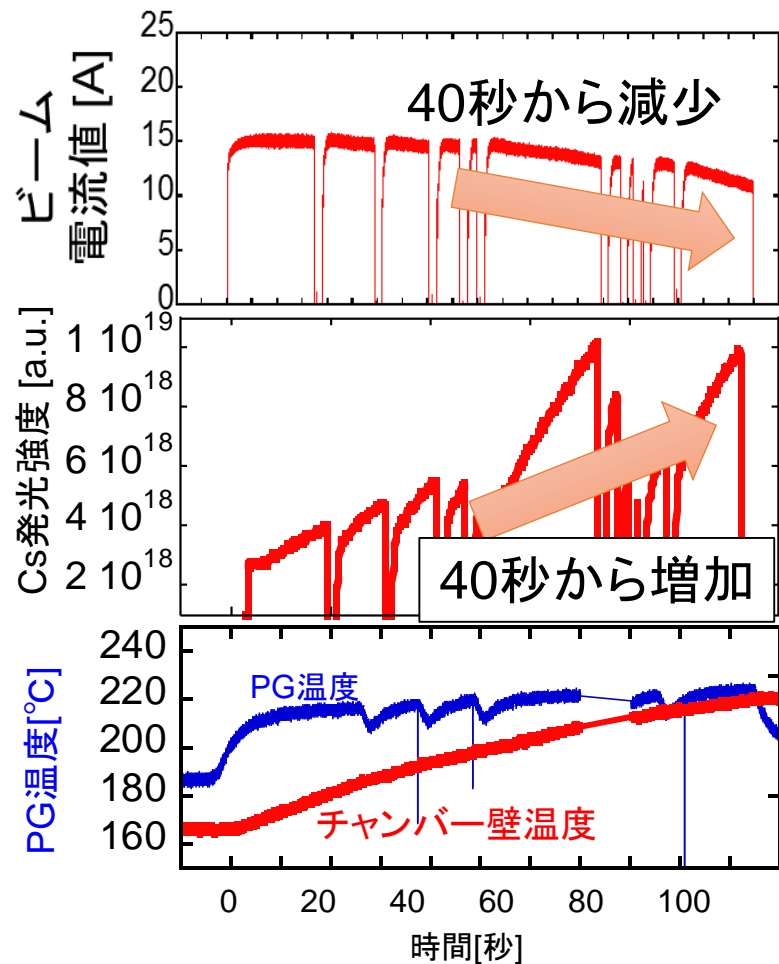
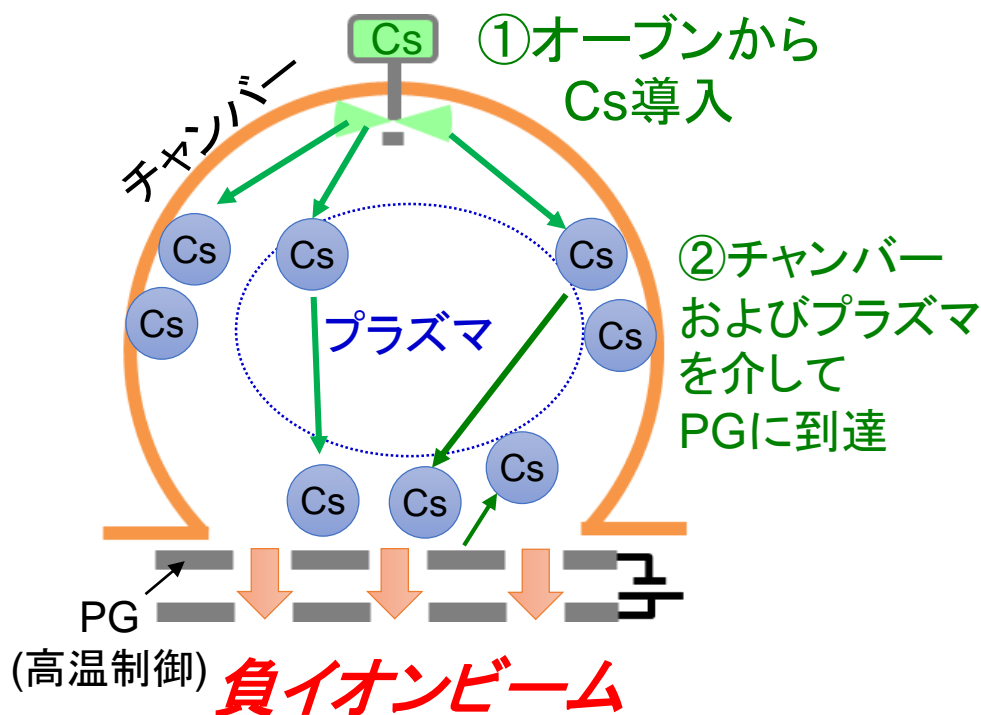
- JT-60SA要求値: 22 A, 100 s
- ITER要求値: 40 A, 3600 s

更なる大電流、長パルス化が必要

更なる大電流、長パルスを
達成するための課題

- パルス数十秒後に徐々にビーム電流値が低下
- アーキングとよばれる異常短絡放電によりビーム生成の瞬間的な停止が頻発

長パルス中のビーム電流値減少原因解明



【着眼点】長パルス中の

- 空間中のCs量変化
 - 各領域の温度変化
- 負イオン生成へ影響

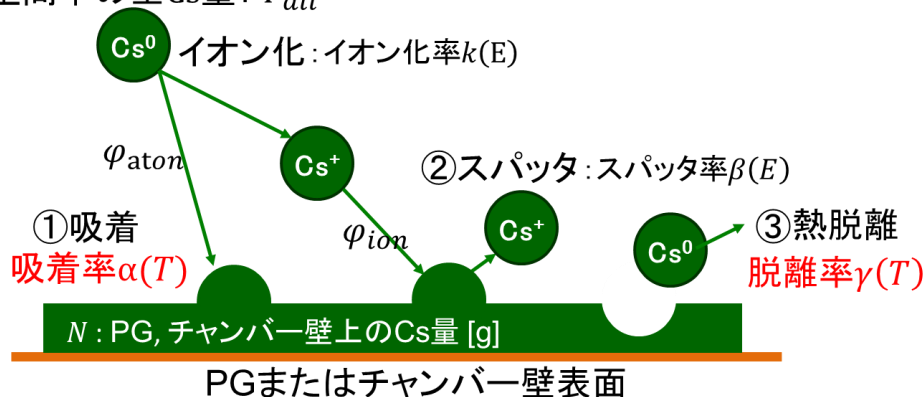
長パルス時の空間中のCs挙動イメージの妥当性を解明するためにCsの吸着・脱離をモデル化

長パルス中のビーム電流値減少原因説明

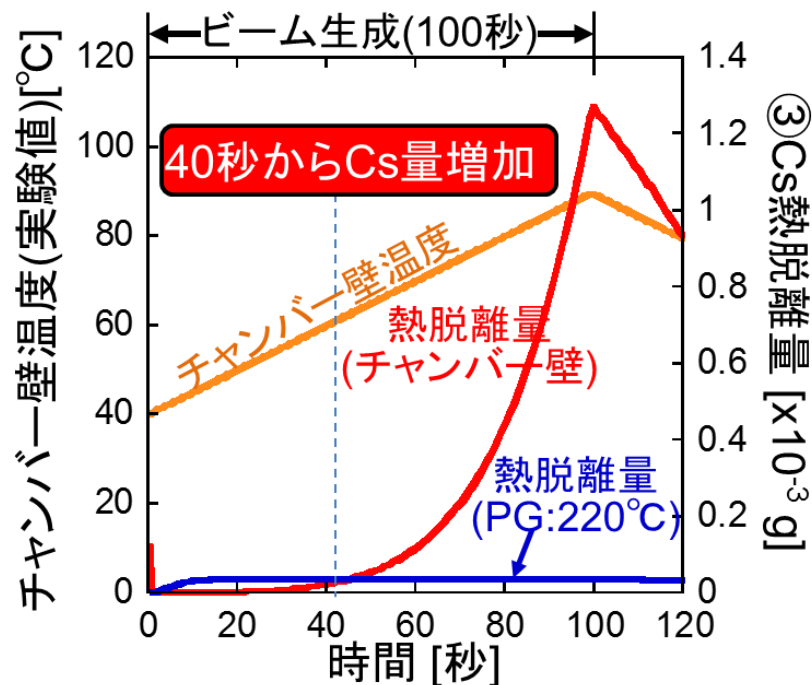
長パルス時のPGおよびチャンバ一壁面のCs吸着・脱離をモデル化

$$\frac{dN(T, E)}{dt} = \underbrace{\alpha(T)\varphi_{atom}}_{\text{① 吸着}} + \underbrace{(1 - \beta(E))\varphi_{Ion}}_{\text{② スパッタ}} - \underbrace{\gamma(T)N}_{\text{③ 熱脱離}}$$

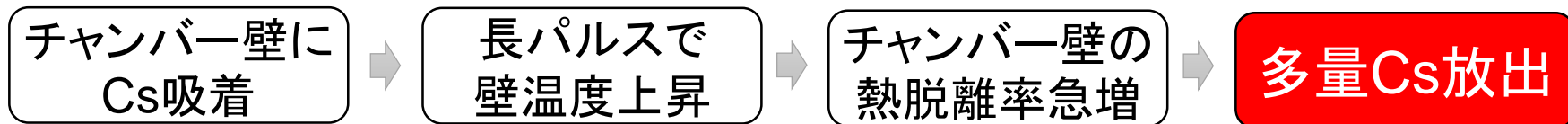
空間中の全Cs量: Φ_{all}



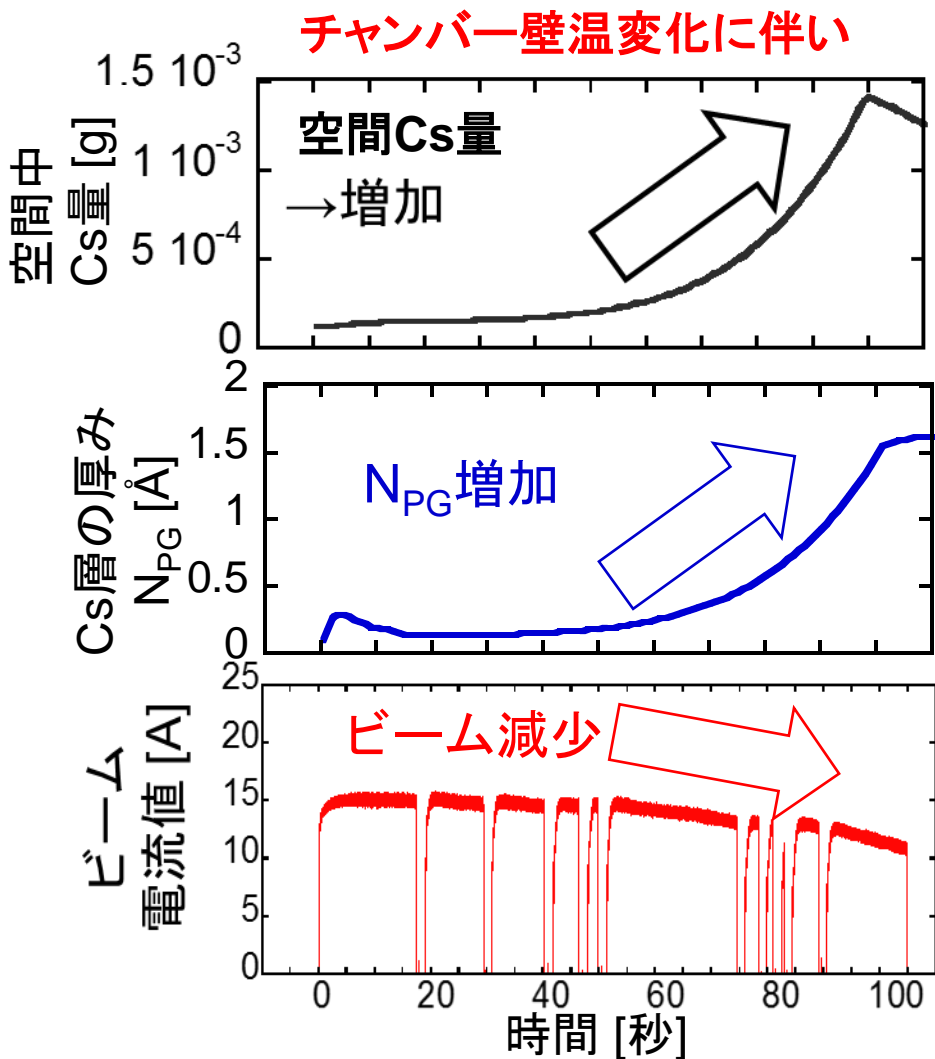
これまで不明であったCs吸着率 α 、脱離率 γ の温度依存性を予備実験で実測→上式に適用



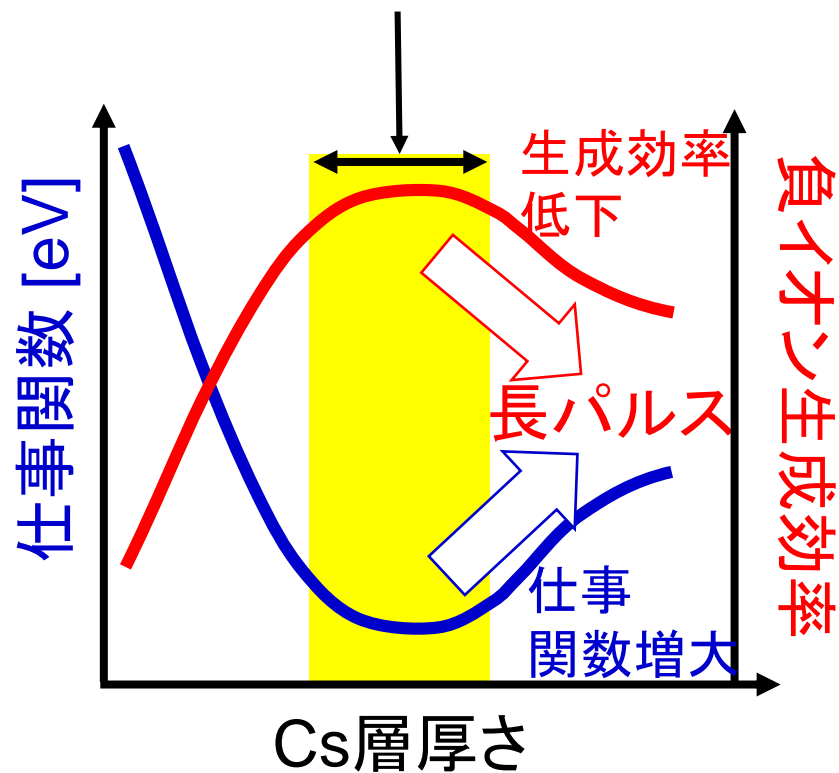
長パルス時の空間中のCsは、チャンバ一壁からのCs脱離が支配的



推察される負イオン生成効率低下の原因

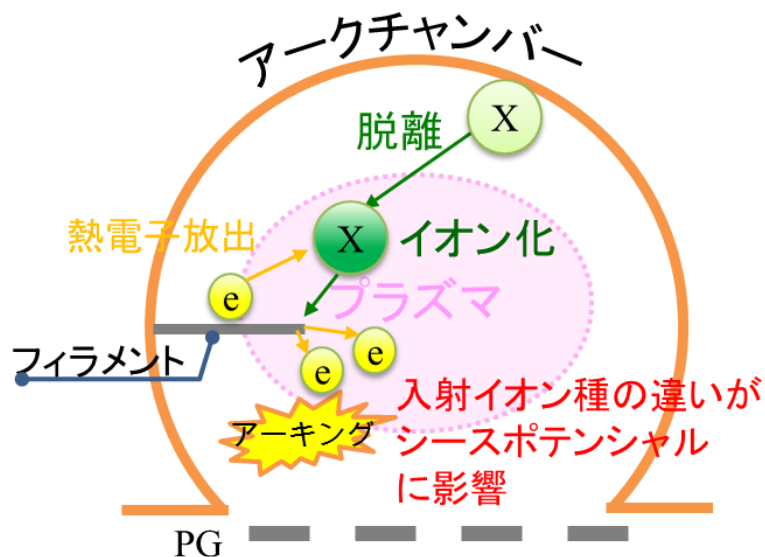


短パルス運転時: 低仕事関数領域
= 高負イオン生成効率領域で大電流化



長パルス運転時には、PG表面のCs層が厚くなることで、仕事関数が増大し、負イオン生成効率が低下したことを示唆

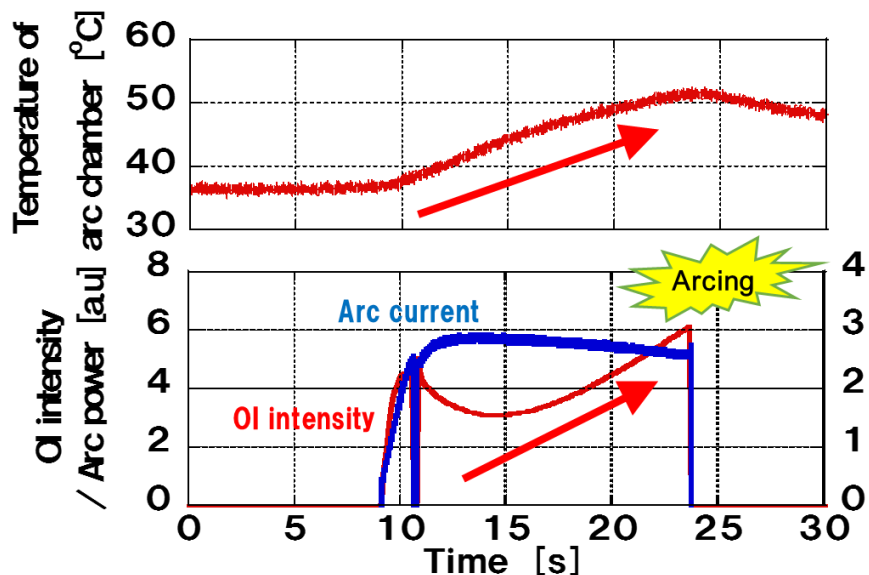
長パルス中でのアーキング増加原因説明



大電流、長パルス運転時にはアーキングが頻発

- ビーム安定生成を阻害
- フィラメント断線

⇒アーキング発生機構を理解し、抑制することが必要



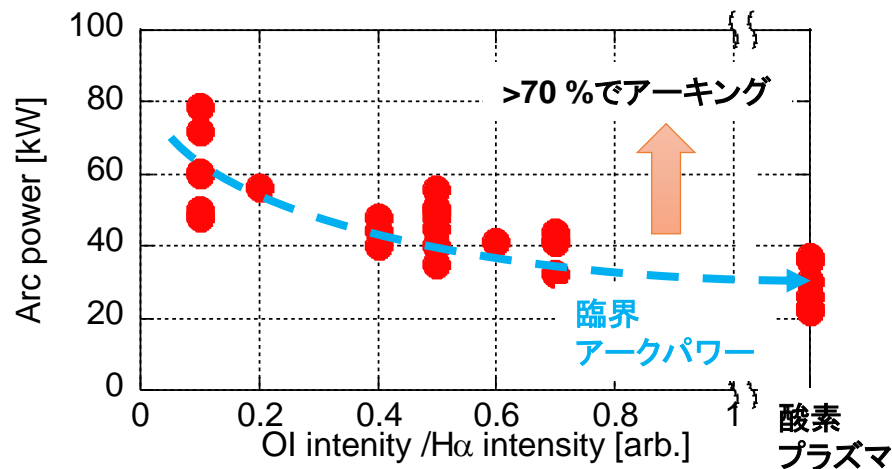
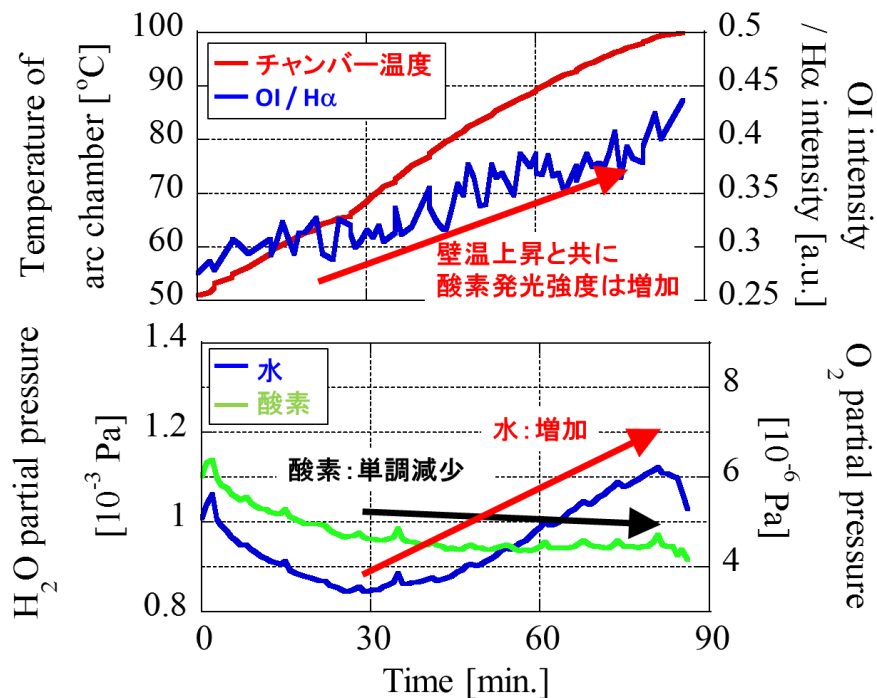
- チャンバー壁温上昇に伴い酸素の発光強度が増加
- 酸素発光強度が増加し、アーキング発生

酸素がアーキングの原因の一つである可能性

パルス中の壁温上昇に伴う酸素の増加とアーキング発生率の関係

酸素によるアーキングへの影響

O₂ガスを外部から導入して能動的に酸素量をコントロール
⇒アーキング頻発の臨界アークパワーの酸素量による変化を測定



- 酸素量増加により臨界アークパワーが低下
- プラズマ中の酸素は水由来
 - 酸素によるアーキング増加を低減するにはベーキングによる壁面吸着水分の低減が有効

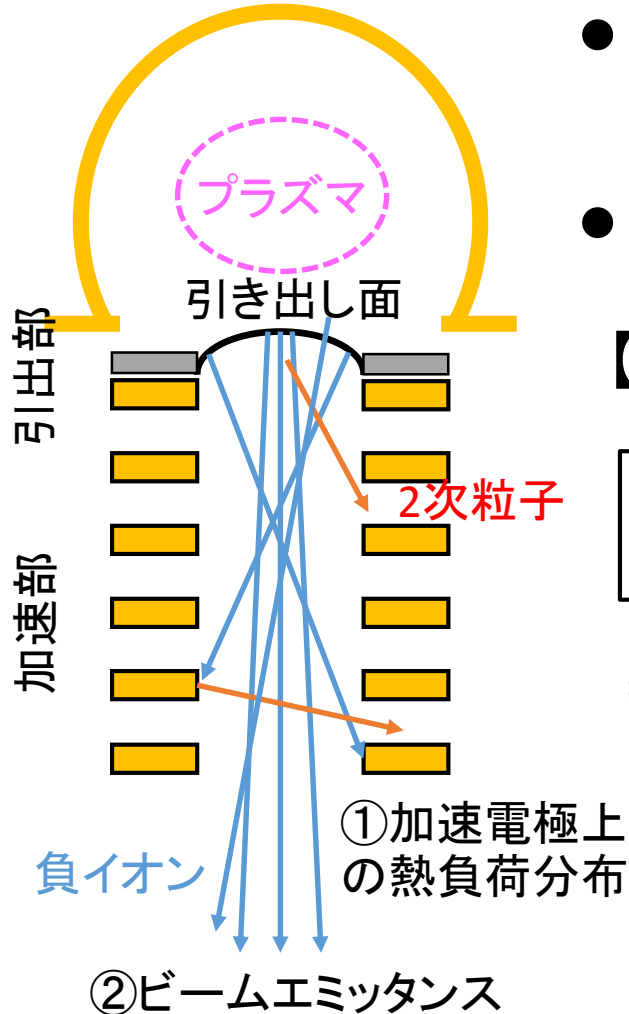
もう一つの不純物としてCsに関して研究継続中

MeV級加速器

負イオン長時間加速



負イオン加速器内の負イオン軌道の理解



- 負イオンは引き出し面(メニスカス)形状次第で様々な軌道を描き、一部は電極に衝突し、一部は2次粒子を発生させる。
- 熱負荷の抑制 ← **負イオン軌道の理解**が必要。

【実験的なアプローチ】

負イオン全体の軌道を理解するためには負イオンと2次粒子の位置と量の測定が必要。

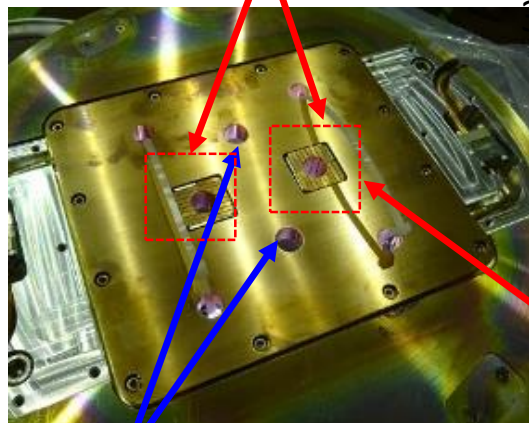
- ⇒ ① 電極に衝突する分: 加速電極上の熱負荷分布
② 加速器を抜ける分: ビームエミッタンス
- ①、②を直接測定できれば、逆に辿って負イオン軌道を再現することができる。

今回は、加速電極上の熱負荷分布を直接測定できる加速電極を開発し、MeV級加速器において試験を行った。

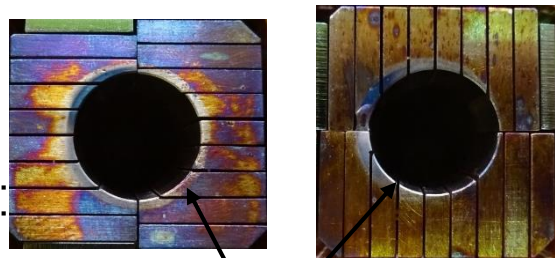
熱負荷分布を直接測定する電極を開発

【電極外形】

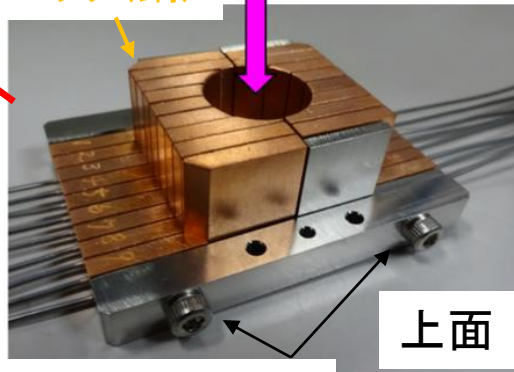
熱負荷分布測定電極



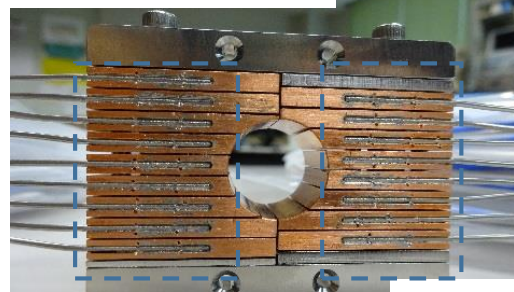
ブロック間隙間0.3mm ↓



ブロック(銅) H-beam



ステンレスボルト

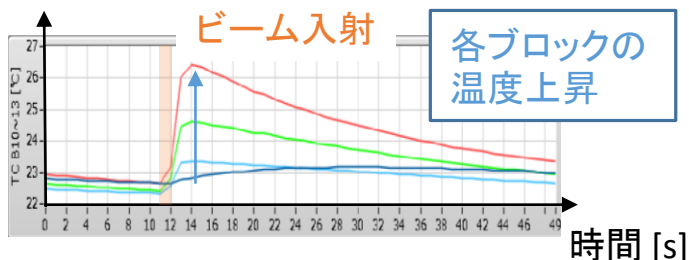


熱電対をロウ付け 下面

【測定方法】

- ビーム孔周辺を17個×2の銅ブロックで構成。
- 各ブロックの底面に熱電対をロウ付け。

各ブロックの温度 [°C]

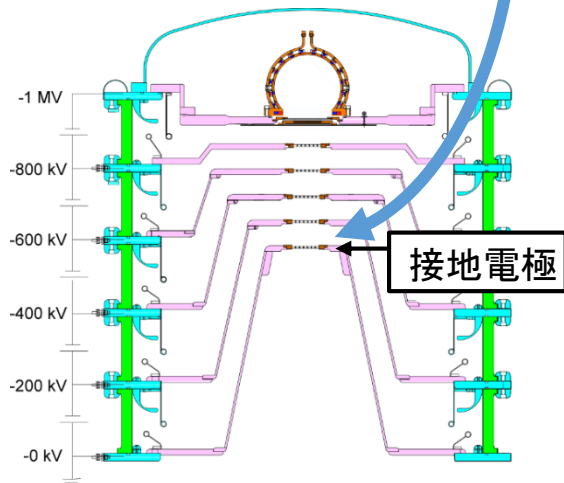


各ブロックに入射した熱量

加速孔周辺の熱負荷密度分布

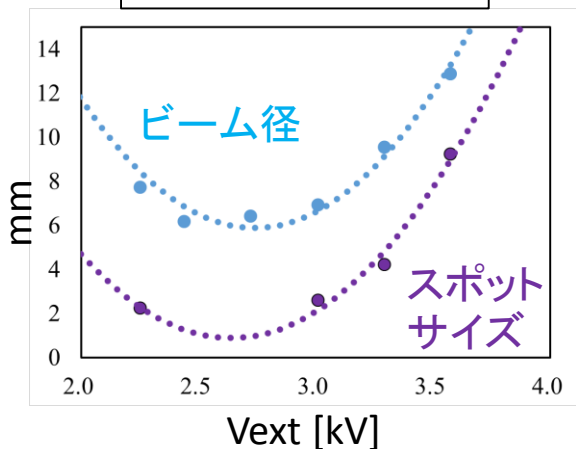
計34個のブロックの温度上昇から、ビーム入射時の熱負荷密度分布を測定する。

通常の加速孔



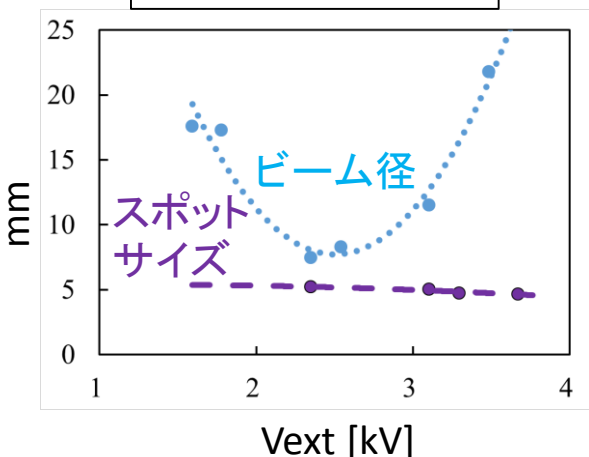
熱負荷分布測定

引き出し電圧依存



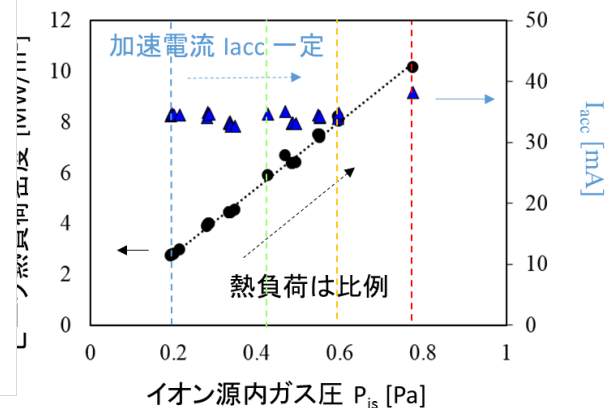
ビーム径の広がり と 相関

引き出し電圧依存

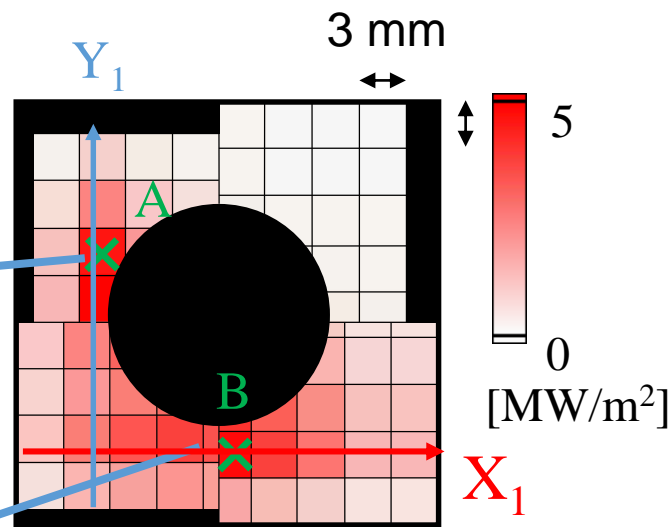


ビーム径の広がり と 相関がなく、ガス圧に依存

ガス圧依存



2箇所ホットスポットを確認



A点はイオンビーム由来
B点はガスとの衝突で生じる
(ストリッピング)電子由来

負イオンと電子による熱負荷を
別々に測定することに成功

まとめ

ITER及びJT-60SAに向けた大電流負イオンビームの長パルス化において以下の成果を得た

負イオンの定常生成について

- 長パルス運転時のビーム強度の低下とPG表面上の吸着Cs量の増加の間の相関を得た。
- 酸素によりアーキングが助長されることを明らかにした。

負イオンの長時間加速について

- 引き出し孔近傍の熱負荷分布を測定し、強度の高い2点がそれぞれ負イオン由来、ガスとの衝突で生じる電子由来であることを明らかにした。

得られた成果はJT-60SAやITERの負イオン源の設計に反映